



Tahiti II
超大型生产型原子层沉积系统
(3代面板以上)

功能特点:

- ※ 超大型生产型原子层沉积系统
- ※ 支持3代、4代、4.5代、5代、5.5代、6代和7代面板尺寸
- ※ 可以半自动或自动上下片
- ※ 可扩展臭氧发生器
- ※ 可集成手套箱设备

应用领域:

- ※ 芯片封装、半导体 High-k 介电层、纳米涂层、3D 涂层、锂电池、催化剂、太阳能电池、生物医学仿生、荧光材料、OLED 显示、有机材料、电子电路、光学膜等。



系统参数:

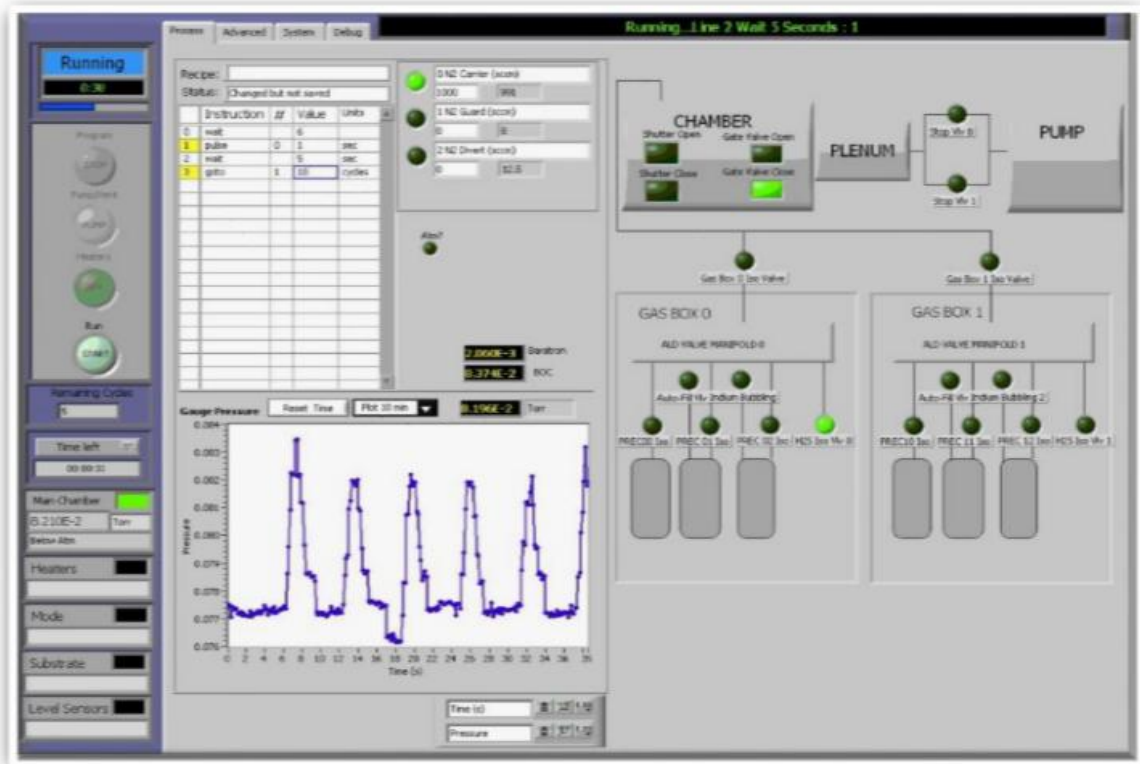
基片尺寸	550mm×650mm、550mm×660mm、550mm×670mm (G3 代面板)
	620mm×750mm、650mm×830mm、680mm×880mm (G4 代面板)
	730mm×920mm (G4.5 代面板)
	1000mm×1200mm、1100mm×1250mm、1100mm×1300mm、1150mm×1300mm (G5 代面板)
	1300mm×1300mm (G5.5 代面板)
	1470mm×1770mm、1500mm×1800mm、1500mm×1820mm、1800mm×2000mm (G6 代面板)
	2160mm×2460mm (G7 代面板)
沉积均匀性 (Al ₂ O ₃)	<2%
前驱通道	标配 4 路, 可扩展至 6 路, 每路均可通固、液、气前驱物, 各路均可独立加热至 200℃
	工业级 ALD 专用快速阀门, 响应时间 10ms
	钢瓶容积 1.6L (装 800ml)
运载气体	N ₂ 气或 Ar 气, MFC 控制, 200-2000sccm
工作电源	220VAC, 3 相, 36KW
操作系统	Windows™ PC
机柜	排气柜装有烟雾报警器
外观尺寸 (W x D x H)	2530 x 1422 x 2972 mm (G5.5 代)
兼容性	100 级洁净室
质量认证	CE, TUV, FCC
系统选配	Ozone Generator
	Glove Box Interface
	LVPD
	Semi-Automatic or Automated Loader
	SECS/GEM 跟主机通讯接口



可沉积膜层:

膜层分类	膜层材料
氧化物	Al ₂ O ₃ , HfO, La ₂ O ₃ , SiO ₂ , TiO ₂ , ZnO, ZrO ₂ , Ta ₂ O, In ₂ O ₃ , SnO ₂ , Fe ₂ O ₃ , MnO _x , Nb ₂ O ₅ , MgO, Er ₂ O ₃ , WO _x , MoO ₃ , V ₂ O ₃ , CeO _x
氮化物	WN, Hf ₃ N ₄ , Zr ₃ N ₄ , AlN, TiN, NbN _x , TaN, CoN, SiN, MnN, NbTiN
硫化物	ZnS, MoS ₂ , WS ₂ , VS ₂
金属	Ru, Pt, W, Ni, Fe, Co, Mn, Cu
复合物	AZO, ITO, ATO, ZnOS, HfSiO _n , LiMnO _x
有机物	FOTS, FDTS, Thiols

操控界面: 专业化 开放化 人性化



通过 GUI 操控界面可以实现参数设置、系统动态监控、数据记录、存储与显示，用户可以自编程。